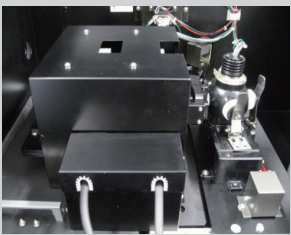

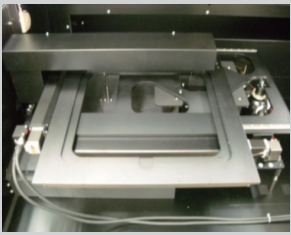


紫外可視赤外分光光度計UH4150 自動測定システム

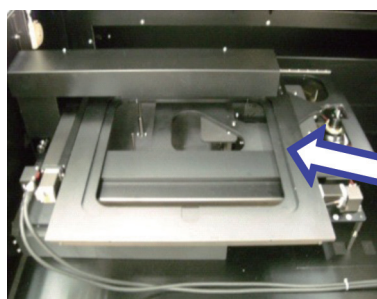
UV-VIS-NIR Spectrophotometer UH4150 Automatic Measurement System

ご好評を戴いております UH4150 形分光光度計と自動角度可変絶対反射付属装置，自動偏光付属装置，自動X-Yステージ付属装置をそれぞれシステム化し，販売を開始しました。測定の自動化を図ることにより，測定値の再現性向上，また測定に関わる時間の短縮が図れます。

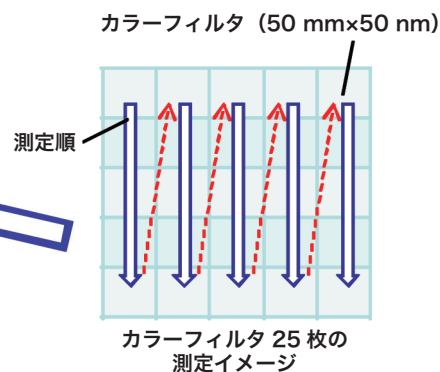
システム	写真	特長
自動偏光測定システム		<ul style="list-style-type: none"> 自動偏光付属装置は偏光解消板を内蔵しており，装置の光学特性を含まない測定が可能。 透過率の最も低くなるクロスニコルの状態を最小 0.01° 単位で自動検出し，再現性の良い測定結果の取得可能。 色彩 (X, Y, Z)、L*, a*, b*, L, a, b、L*, u*, v*、色度座標 x, y、偏光度の算出が可能
自動角度可変測定システム		<ul style="list-style-type: none"> 自動角度可変付属装置は任意設定した条件（偏光子，入射角度，受光角度）の透過，反射スペクトルを連続自動で測定。 絶対正反射率（5°～60°）を自動で測定 1 サンプル^{注1)}の作業時間を約 96% 削減可能。 <p>注 1) 5～70 度（5 度毎），波長 300～800 nm，反射スペクトル測定計 28（S, P 偏光）測定の場合</p>
自動 X-Y ステージ測定システム		<ul style="list-style-type: none"> 自動 XY ステージ付 5° 反射 / 透過測定付属装置を搭載し，自動で入射角 5° の相対反射スペクトル及び入射角 0° の透過スペクトルが測定可能。 あらかじめ測定箇所を指定する事で，指定した箇所を連続測定。 試料の設置などに関わる時間を大幅に削減することが可能^{注2)}。 <p>注 2) 測定箇所 25 点, 実測定時間を除いた作業時間を 92%削減可能。</p>



UH 4150 形分光光度計



自動 XY ステージ付 5° 反射 / 透過測定付属装置外観



自動 XY ステージ付 5° 反射 / 透過測定付属装置外観と試料測定イメージ